

編集委員

- 出版部会長 間 紀 旺 (慶 應 大)
委員 長 田 一 朗 (法 政 大)
幹事 梶 原 優 介 (東 京 大)
酒 井 康 徳 (芝 浦 工 業 大)
委員 青 木 公 也 (中 京 大)
池 田 慎 一 (苫 小 牧 高 専)
石 川 貴 一 郎 (日 本 工 業 大)
浮 田 芳 昭 (山 梨 大)
江 川 悟 (東 京 大)
大 坪 樹 (長 崎 大)
鍛 島 麻 理 子 (産 総 研)
カチョーンルンルアン・
パナート (九 州 工 業 大)
金 子 和 暉 (茨 城 大)
金 子 健 正 (長 岡 高 専)
河 合 謙 吾 (DMG 森 精 機)
喜 入 朋 宏 (ミ ッ ト ヨ)
木 下 裕 介 (東 京 大)
喜 藤 寛 文 (オ リ ン パ ス)
河 野 一 平 (日 立 製 作 所)
児 玉 紘 幸 (岡 山 大)
神 保 康 紀 (東 京 電 機 大)
高 梨 耕 史 (キ ャ ノ ン)
中 島 省 吾 (牧 野 フ ラ イ ス 製 作 所)
難 波 江 裕 之 (東 京 工 業 大)
成 澤 慶 宜 (埼 玉 大)
土 方 康 弘 (東 京 工 業 大)
福 山 康 弘 (日 産 自 動 車)
松 井 翔 太 (木 更 津 高 専)
松 隈 啓 (東 北 大)
水 谷 康 弘 (大 阪 大)
安 田 穂 積 (荏 原 製 作 所)
山 口 大 介 (岡 山 大)
山 下 典 理 男 (理 研)
学 生 委 員
小 沢 光 輝 (埼 玉 工 業 大)
後 藤 陽 介 (埼 玉 大)
小 林 泰 生 (埼 玉 大)
坂 本 康 輔 (千 葉 大)
田 中 海 翔 (同 志 社 大)
宮 崎 一 磨 (日 本 大)
渡 辺 昇 陽 (埼 玉 工 業 大)

次号予告

特集

- [細胞の精密操作と解析技術]
電界誘起気泡によるバイオメディカル機能創発
精密電鍍加工による細胞捕捉用フィルター
有機材料の微細加工による生体親和性電気刺激・計測システムの開発
低レイノルズ数流れ中における微粒子運動の解析
植物の個体から細胞までを操作するための技術開発
ナノマイクロ加工を応用したボディ・オン・チップの開発
グラビア&インタビュー
Craig 株式会社
私の歩んできた道
高増 潔 (3回目)
はじめての精密工学
微分可能プログラミングで始める機械学習
研究所・研究室紹介
福井大学学術研究院工学系部門 知能システム工学講座

特集

「精密」を照らす、「精密」で輝く、照明・光源技術

展望

目に見えない光が切り拓く「光の世紀」

安井 武史/南川 丈夫/時実 悠/久世 直也/駒 貴明/上田 隆雄/野間口雅子

587

解説

画像処理検査用光源・照明の技術動向

櫻井 顕治

592

生物顕微鏡におけるデジタルマイクロミラーデバイスの応用事例

金城 純一/大西秀太郎

597

ダイナミックイメージコントロールにおける照明・投影技術の展開

奥 寛雅

601

可視光半導体レーザー応用の現状と展望

山本 和久

606

量子もつれ光源と光量子センシング

竹内 繁樹

610

私の歩んできた道

知的計測学：ものづくりを支える知的計測技術の体系化

三次元測定機に関する研究をスタート 連載第2回/全3回

高増 潔

622

グラビアとインタビュー 精密工学の最前線

多様化する光計測ニーズに最適なソリューションを提案

583

旭光通商株式会社 川島 信之/山西 幸男

インタビュー：寺沢 智丈

はじめての精密工学

触覚力覚の計測

奥山 武志

615

研究所・研究室紹介

日本工業大学 基幹工学部 機械加工研究室

620

会員企業を訪ねて

10年、20年後に「買ってよかった」と言われる工具研削盤を目指して

牧野フライス精機株式会社

628

精密工学会創立90周年記念特集号(2024年1月号)

「名刺スタイル紹介ページ」募集開始のお知らせ

- 会報：お知らせ(2024年4月号からの投稿論文について) 631
会報：投稿論文等校閲のお礼 632
アフィリエイト通信 623
会告 告8-1
編集後記 告8-9

複写される方へ

本誌に掲載された著作物を複写したい方は、(株)日本複写権センターと包括複写許諾契約をされている企業の方でない限り、著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けてください。107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 一般社団法人学術著作権協会 電話：03-3475-5618, FAX：03-3475-5619 E-mail：info@jaacc.jp 著作物の転載・翻訳のような、複写以外の許諾は、直接本会へご連絡下さい。

論文

- マシニングセンタの直動軸運転時における案内部の発熱が熱変形挙動に及ぼす影響とその低減法の検討 ————— 634
近藤凌司, 大橋一仁
- 第一原理計算による半導体基板表面の各種材料 (SiO_2 , Si_3N_4 , poly-Si) への CeO_2 吸着解析 ————— 642
増谷浩一, 大淵真志, 高東智佳子, 宇野 恵, 濱田聡美, 倉下将光, 福永 明, 三上益弘
- CNC 自動旋盤による摩擦圧接に関する研究 ————— 648
—A6061 材の摩擦圧接条件と接合材の機械的特性の関係—
田中秀岳, 山本大雅, 北風絢子, 鈴木敏之, 中谷尊一
- MMS 取得点群からの道路面における領域・線状型損傷のベクトルデータ抽出 ————— 654
本間亮平, 伊達宏昭, 金井 理
- コンタクトレンズへの薄膜コーティングを用いた眼瞼圧分布の測定法 ————— 661
—第3報 動物実験による安全性評価と擦過痕形成—
初澤 毅, 森 優太

上記論文は J-STAGE (科学技術情報発信・流通総合システム) にて会員・会員外を問わず、公開されています。

<https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjspe/-char/ja>

したがって 634~664 ページは本冊子には掲載されていません。

本冊子でのページ番号は抜けていますが、落丁などではございませんのでご了承ください。